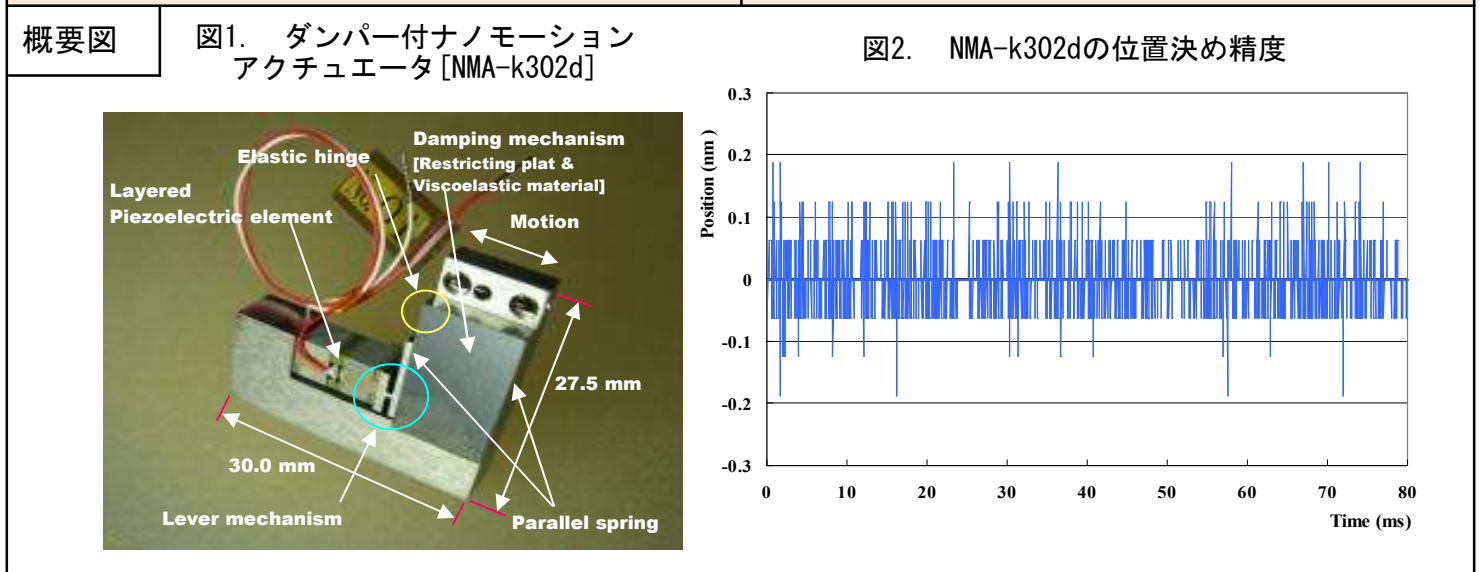


シーズの名称	<b>サブナノメートルの高速位置決めに挑む</b> ～サブナノの位置精度と高帯域サーボ技術への挑戦 I～		
--------	---	--	--

シーズの特性		活用が期待される分野	製造業
権利等の種類	特許	環境浄化	機械・器具
権利状態	県単独所有	工具	IT
実施許諾実績	あり(自己実施)	液晶	検査装置
現状(段階)	研究開発	金型	自動車
特許権の譲渡	不可	電子部品	計測装置
		センサ	表面処理
		その他	光学機器
			通信機器



特徴	<ul style="list-style-type: none"> <li>・0.1nmの位置決め精度を有しながら、高速な応答を可能とする微動アクチュエータです。</li> <li>・開発目標(逐次実用化)</li> </ul> <p>→位置決め精度:0.1nm (3σ)、動作距離:10 μm~500 μm、サーボ帯域:1kHz以上</p>
----	--

独自性	<p>○積層型圧電素子と変位拡大機構で構成されるNano-motion Actuatorに“特許第3612670号”を適用することで、0.1nmの位置決め精度と1kHz以上のサーボ帯域を実現する高速性を両立させた微動アクチュエータを世界で初めて開発しました。</p>
-----	---

サポート	<p>実用化に向けた技術支援</p>
------	--------------------

- |        |  |
|--------|--|
| 特許・論文等 | <ol style="list-style-type: none"> <li>①アクチュエータの減衰方法およびアクチュエータ(特許第3612670号、US7332848B2)</li> <li>②アクチュエータ(特許第5076063号)</li> <li>③位置決め機構(特許第5028659号)</li> <li>④平面位置決め機構(特許第5605227号)</li> <li>⑤平面位置決め装置およびこれを備えた検査装置(US8495761B2)</li> </ol> |
|--------|--|

キーワード	<p>高速・高精度位置決め、半導体の露光や回路パターンの検査</p>
-------	------------------------------------

関連記事等	<p>なし</p>
-------	-----------

お問い合わせ先	<p>秋田県産業技術センター 技術イノベーション部 TEL: 018-862-3414 Email: soudanshitu@rdc.pref.akita.jp</p>
---------	--